

(15)

УДК 621.315.592

© 1994 г. ВЛАСЕНКО А. И., ГНАТЮК В. А., КОПИШИНСКАЯ Е. П.,
 КЛАДЬКО В. П., КРЫШТАБ Т. Г., ЛУКЬЯНЕНКО В. И.,
 МОЗОЛЬ П. Е., СУКАЧ А. В.

(35)

ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУРЫ И МОРФОЛОГИИ ПОВЕРХНОСТИ ЭПИТАКСИАЛЬНЫХ СЛОЕВ $Cd_xHg_{1-x}Te$ ПРИ НАНОСЕКУНДНОМ ЛАЗЕРНОМ ОБЛУЧЕНИИ

Методами рентгеновской топографии, дифрактометрии и электронно-зондового микронализа исследовано влияние наносекундных импульсов излучения рубинового лазера на структуру и морфологию поверхности эпитаксиальных слоев $Cd_xHg_{1-x}Te$, имеющих области малой разориентации. Показано, что плавление и перекристаллизация при плотности энергии $> 0,16 \text{ Дж}/\text{см}^2$ происходят в приповерхностной области толщиной $< 1 \text{ мкм}$. В этой же области изменяется состав твердого раствора. Проанализирована связь наблюдавшегося ранее эффекта лазерного фотоочувствления исследуемых слоев с геттерирующим действием границ ячеек по отношению к точечным дефектам.

Использование твердого раствора кадмий — ртуть — теллур (КРТ) в качестве базового материала для изготовления фотоприемников в ИК-диапазоне обуславливает поиски путей улучшения его фотоэлектрических свойств [1]. Проведенные исследования воздействия наносекундных импульсов лазерного излучения (ИЛИ) на кристаллы, эпитаксиальные слои и пленки $Cd_xHg_{1-x}Te$ выявляют существенную зависимость изменений фотоэлектрических, гальваномагнитных, зонных параметров от исходной структуры образцов. В частности, облучение КРТ вызывает уменьшение интенсивности сигнала фотопроводимости в структурно совершенных материалах [2, 3] и повышение фотоочувствительности в эпитаксиальных слоях с ячеистой структурой [4]. Последний эффект наблюдается при действии ИЛИ как с плотностью энергии E допороговой, так и с $E > E_n$, приводящей к нарушению морфологии поверхности эпитаксиального слоя. В этом случае происходит изменение электрофизических параметров твердого раствора (уменьшение эффективной концентрации и рост подвижности электронов), что и обуславливает увеличение фотопроводимости.

Электрические свойства КРТ определяются системой точечных и протяженных дефектов, а также их взаимодействием [5—7]. Для выяснения причин модификации фотоэлектрических и электрофизических параметров и получения дополнительной информации о перераспределении компонентов твердого раствора, характере и глубине структурных изменений проводили исследования состава, морфологии поверхности, а также структуры приповерхностной области эпитаксиальных слоев КРТ, подвергнутых воздействию ИЛИ в диапазоне плотностей энергии, приводящих к фотоочувствлению.

Методы исследования

Эпитаксиальные слои КРТ, полученные методом испарение — конденсация — диффузия на подложках высокомонного $CdTe$ ориентации (111) имели ячеистую структуру, обусловленную исходным строением подложки. Области малой разориентации составляли $\sim 20''$. После отжига в парах ртути эпитаксиальные слои обладали n -типом проводимости с эффективной концентрацией электронов $n_{\text{eff}} =$

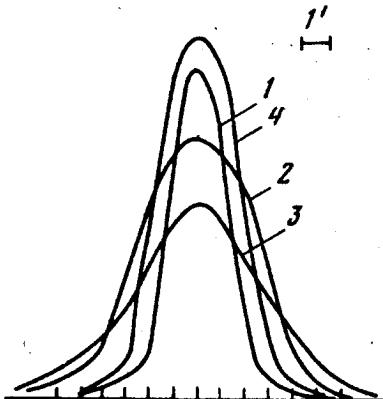


Рис. 4. Кривые дифракционного отражения эпитаксиального слоя КРТ до (1) и после облучения с плотностью энергии E (Дж/см²): 2 — 0,02, 3 — 0,32, 4 — 0,64

В рассматриваемом случае электронно-зондовый анализ облученной наносекундными ИЛИ (с $E > E_0$) поверхности эпитаксиального слоя КРТ в различных точках, отмеченных на растровой электронной микрофотографии (рис. 2), не выявил неоднородностей, превышающих погрешность метода. При этом на поверхности эпитаксиального слоя образуется пленка Тe [4], которая ввиду малой толщины не оказывает существенного влияния на измерения состава рентгеноспектральным методом, глубина информационного интегрального анализа которого ~3 мкм.

На рис. 3, а приведена рентгеновская топограмма, отражающая ячеистую структуру эпитаксиального слоя КРТ до облучения на глубине ~20 мкм. Размеры ячеек, расположенных преимущественно в направлении $\langle 110 \rangle$, составляют 0,1—0,2 мкм. Облучение с различной плотностью энергии не приводит к сколько-нибудь существенным изменениям в топограмме, что свидетельствует о неизменности структуры эпитаксиального слоя на глубине ~20 мкм.

Топограмма, сформированная тем же участком эпитаксиального слоя КРТ с глубины ~3 мкм, также выявляет дендритную структуру образца с той же ориентацией ячеек (рис. 3, б). Данный факт свидетельствует о столбчатой структуре слоя. Некоторое различие ячеек на снимках а и б вызвано, возможно, разными углами отражения рентгеновского излучения при снятии топограмм с 20 и 3 мкм. Границы ячеек исходного образца (рис. 3, б) имеют преимущественно белый контраст, что может быть вызвано скоплением в областях малой разориентации, в основном дислокаций с плотностью не больше ~10⁷ см⁻².

Полуширина КДО от слоя до облучения (отражение 222) не превышает полуширину КДО от подложки и составляет ~3' (рис. 4, кривая 1). Состав приповерхностной области исходного образца, оцененный по интегральной интенсивности отраженного рентгеновского сигнала, коррелирует с измерениями, полученными при электронно-зондовом микроанализе поверхности, и соответствует $x \approx 0,20$.

После допорогового облучения (с $E_1 = 0,02$ Дж/см²) образца полуширина КДО увеличивается в ~2 раза (рис. 4, кривая 2), следовательно, на глубине ~3 мкм возрастает разориентация ячеек. Их границы несколько уширяются и становятся более четкими, однородными (рис. 3, в), что может быть связано с увеличением плотности дислокаций на них, а также со скоплением примесей в областях малой разориентации. Отсутствие значительного роста интегральной интенсивности рентгеновского сигнала для отражений 111 и 333 свидетельствует в пользу доминирования последнего процесса. На это указывает и появление темных полос (недифрагирующие области) на топограмме облученного эпитаксиального слоя.

С процессом миграций точечных дефектов к границам связана, по-видимому, разориентация ячеек. Некоторое увеличение интегральной интенсивности отраженного рентгеновского сигнала (рис. 4, кривая 2) свидетельствует об уменьшении x состава приповерхностной области эпитаксиального слоя КРТ. Указанный

эффект, проявляющийся и в спектрах фотопроводимости [4], наряду со снятием напряжений может быть вызван диффундированием эпитаксиального слоя Hg из объема к поверхностному слою [12]. В условиях лазерного отжига коэффициенты диффузии собственных и примесных точечных дефектов могут возрастать на несколько порядков [13], обеспечивая тем самым возможность их миграции.

Облучение эпитаксиального слоя с плотностью энергии выше пороговой ($E_2 = 0,32$ Дж/см²) приводит к увеличению поверхностного состава по сравнению с исходными образцами (интегральная интенсивность сигнала упала) и вызвано лазерной десорбцией ртути и частичным испарением ее из приповерхностной области эпитаксиального слоя. Избыточный теллур при этом выделяется на поверхности образцов в виде тонкой пленки [4]. Полуширина КДО (рис. 2, кривая 3) имеет тенденцию к уменьшению, что свидетельствует о стабилизации процессов сегрегации дефектов на области малой разориентации, укрупнении ячеек и меньшей их разориентации.

При дальнейшей обработке эпитаксиального слоя ИЛИ (с $E_3 = 0,64$ Дж/см²) полуширина КДО несколько уменьшается (рис. 4, кривая 4), отражая повышение степени структурного совершенства приповерхностной области. Существенный рост интегральной интенсивности сигнала указывает на значительное изменение поверхностного состава, что связано, по-видимому, с частичной конденсацией на поверхности образца ртути из парового облака, наблюдавшегося в эксперименте и вызванного испарением ее при лазерной переплавке приповерхностного слоя [10].

Изменение на топограммах контраста ячеек облученных эпитаксиальных слоев (рис. 3, в и г) (из темно-светлых они становятся более серыми) свидетельствует об улучшении их однородности, возможно, вследствие очистки от примесей и точечных дефектов. Такие процессы могут быть обусловлены геттерирующими свойствами областей малой разориентации [6, 7], проявляющимися при воздействии мощных ИЛИ. Все это приводит к повышению структурного совершенства ячеек и является одной из причин роста фотоочувствительности эпитаксиального слоя [4].

Увеличение информационной площади топограмм, сформированных с глубины 3 мкм облученного с различной плотностью энергии эпитаксиального слоя КРТ (рис. 3, в и г), вызвано релаксацией деформационных полей в приповерхностной области. Отсутствие значительной перестройки структуры свидетельствует о сохранении кристаллической фазы КРТ на глубине 1–2 мкм при воздействии наносекундных ИЛИ с $E > E_n$. Последнее подтверждается также отсутствием на топограммах «вуали», характерной для аморфных и сильно разупорядоченных структур. Плавление эпитаксиального слоя происходит в тонкой (порядка глубины поглощения лазерного излучения) приповерхностной области твердого раствора.

Таким образом, проведенные исследования позволяют утверждать, что воздействие наносекундных ИЛИ на эпитаксиальные слои КРТ, имеющие области малой разориентации, приводит к изменению точечно-дефектной структуры приповерхностной области. При $E > E_n$ происходит плавление тонкого (< 1 мкм) поверхностного слоя, сопровождающегося распадом соединения, перераспределением компонентов в этом слое и изменением морфологии поверхности. Геттерирующие свойства границ ячеек служат определяющим фактором при лазерном фотоочувствлении образцов [4], обусловленным сегрегацией электрически активных примесей и собственных точечных дефектов на стоки (дислокации, области малой разориентации [6, 7]). Обработка эпитаксиального слоя КРТ с ячеистой структурой ИЛИ наносекундной длительности позволяет достичь повышения структурного совершенства твердого раствора, тем самым эффективно модифицировать электрофизические свойства материала.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гирич Б. Г., Лакеенков В. М. // Новости науки и техники. 1990. Вып. 3. 59 с.
2. Вирт И. С., Любченко А. В., Мозоль П. Е., Гнатюк В. А. // Физика и техника полупроводников. 1989. Т. 23. № 8. С. 1386.
3. Гнатюк В. А., Каракеевцева Л. А., Любченко А. В., Маловичко Э. А., Мозоль П. Е. // Оптоэлектроника и полупроводниковая техника. 1992. Вып. 23. С. 53.
4. Гнатюк В. А., Власенко А. И., Друзь Б. Л., Лукьяненко В. И., Мозоль П. Е., Сукач А. В. // Изв. РАН. Неорг. материалы. 1992. Т. 28. № 12. С. 2399.
5. Горшков А. В. // Высокочистые вещества. 1989. № 6. С. 207.
6. Баранский П. И., Беляев А. Е., Городничий О. П., Комиренко С. М. // Физика и техника полупроводников. 1990. Т. 24. № 1. С. 121.
7. Любченко А. В., Мысливец К. А., Олих Я. М. // Физика и техника полупроводников. 1990. Т. 24. № 1. С. 171.
8. Паشاев Э. М., Каневский В. М., Пурцхванидзе А. А., Перегудов В. Н. // Физика и техника полупроводников. 1991. Т. 25. № 6. С. 120.
9. Bibilas L. O. // J. Cryst. Growth. 1988. V. 88. № 1— P. 723.
10. Голошихин П. В., Миронов К. Е., Поляков А. Я. // Поверхность. 1991. № 12. С. 12.
11. Загиней А. А., Котлярчук Б. К., Курило И. В., Пляцко Г. В., Савицкий В. Г. // Поверхность. 1986. № 6. С. 76.
12. Талипов Н. Х., Попов В. Н., Ремесник В. Г., Налькина З. А. // Физика и техника полупроводников. 1992. Т. 26. № 2. С. 310.
13. Воронков В. П., Гурченок Г. А. // Физика и техника полупроводников. 1990. Т. 24. № 10. С. 1831.

Институт полупроводников АН Украины,
Киев

Поступила в редакцию
23.XII.1992

Принята в печать
13.I.1993

VLASENKO A. I., GNATYUK V. A., KOPISHINSKAYA Y. P.,
KLADKO V. P., KRISHTAB T. G., LUKYANENKO V. I.,
MOZOL P. Y., SUKHACH A. V.

MODIFICATIONS OF STRUCTURE AND MORPHOLOGY OF THE SURFACE OF EPITAXIAL LAYERS $Cd_xHg_{1-x}Te$ UNDER NANOSECOND LAZER RADIATION

We have studied the epitaxial layers $Cd_xHg_{1-x}Te$ which had regions with small deorientation. The influence of irradiation with ruby laser emission nanopulses on surface structure of layers was investigated by methodes of X-raying, diffractometry and electron microanalyse. It has been shown that melting and recrystallisation take place in the near-surface region of the crystal with affective thickness above $1 \mu m$ under irradiation with power density more then $0.16 J/sm^2$. Solid solution composition changes in this region too. The connection between increasing of photosensitivity of these layers and cell's boundaries action as point defects getter has been analysed.